



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(19)

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 108 375
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 83110891.5

(51) Int. Cl.⁴: B 41 C 1/04

(22) Anmelddatag: 02.11.83

(30) Priorität: 04.11.82 DE 3240653

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.05.84 Patentblatt 84/20

(88) Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 01.04.87

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: DR.-ING. RUDOLF HELL GmbH
Grenzstrasse 1-5
D-2300 Kiel 14(DE)

(72) Erfinder: Beisswenger, Siegfried
Albert-Einstein-Strasse 22
D-2308 Preetz(DE)

(72) Erfinder: Boppel, Wolfgang
Otto-Hahn-Strasse 22
D-2308 Preetz(DE)

(54) Verfahren zur Kontrolle von mittels elektronenstrahlgravierten Druckformoberflächen.

(57) Die Erfindung besteht darin, daß ein für die Gravur von Druckformzylinderoberflächen ausgebildeter Elektronenstrahlerzeuger in den Gravurpausen auf Mikroskopbetrieb umgeschaltet wird, um sofort und ohne zusätzliche Hilfsmittel die gravirten Näpfchen sichtbar zu machen.

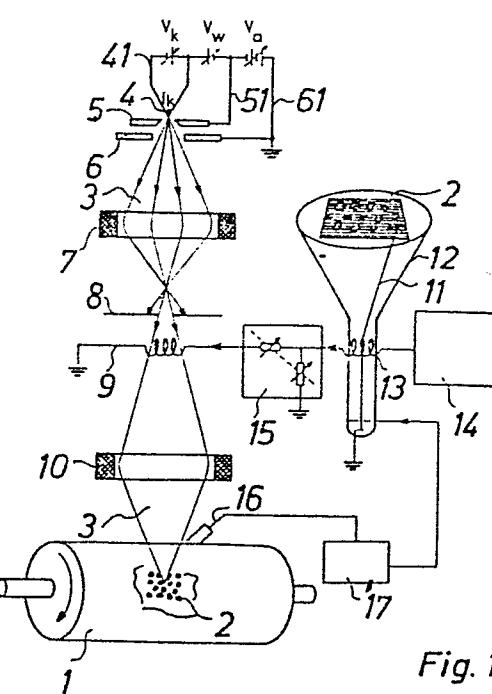


Fig. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0108375

Nummer der Anmeldung

EP 83 11 0891

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int Cl. 5)
Y	DE-A-2 354 323 (CROSFIELD) * Seite 1; Seite 12, Zeilen 9,10 *	1	B 41 C 1/04 H 01 J 37/30
Y	--- US-A-3 881 108 (KONDO) * Spalte 3, Zeilen 6-47; Spalte 7, Zeile 31 - Spalte 8, Zeile 7 *	1	
Y	--- APPLIED PHYSICS LETTERS, Band 34, Nr. 5, 1. März 1979, Seiten 310-312, American Institute of Physics, New York, US; R.L. SELIGER et al.: "A high-intensity scanning ion probe with submicrometer spot size" * Seite 310, linke Spalte, Absätze 1,2; Seite 311, rechte Spalte, Absätze 2,3 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int Cl. 5)
			B 41 C H 01 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 04-12-1986	Prüfer DE ROECK A.F.A.	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie übereinstimmendes Dokument	